



Recherche ▾

IPC

Service ▾

Namen/Nummern/Suchbegriffe

Bibliografische Daten

Dokument DE102015204586A1 (Seiten: 49)

Dokument 1/1

⋮

BIBLIOGRAFISCHE DATEN DOKUMENT DE102015204586A1 (SEITEN: 49)			
INID	Kriterium	Feld	Inhalt
54	Titel	TI	[DE] Verfahren zur Fertigungsoptimierung
71/73	Anmelder/Inhaber	PA	Demaj, Arben, 65936, Frankfurt, DE
72	Erfinder	IN	Demaj, Arben, 65936, Frankfurt, DE
22/96	Anmeldedatum	AD	13.03.2015
21	Anmeldenummer	AN	102015204586
	Anmeldeland	AC	DE
	Veröffentlichungsdatum	PUB	15.09.2016
33	Priorität	PRC	
31		PRN	
32		PRD	
51	IPC-Hauptklasse	ICM	G06Q 50/04 (2012.01)
51	IPC-Nebeklasse	ICS	G06F 19/00 (2006.01) G06Q 10/04 (2012.01)

INID	Kriterium	Feld	Inhalt
			➤ G07C 3/08 (2006.01) ➤ G07C 3/14 (2006.01)
	IPC-Zusatzklasse	ICA	
	IPC-Indexklasse	ICI	
	Gemeinsame Patentklassifikation	CPC	➤ G05B 19/41875 ➤ G06Q 10/04 ➤ G06Q 50/04 ➤ G07C 3/08 ➤ G07C 3/14 ➤ Y02P 90/02 ➤ Y02P 90/30
	MCD-Hauptklasse	MCM	➤ G06Q 50/04 (2012.01)
	MCD-Nebeklasse	MCS	➤ G06F 19/00 (2011.01) ➤ G06Q 10/04 (2012.01) ➤ G07C 3/08 (2006.01) ➤ G07C 3/14 (2006.01)
	MCD-Zusatzklasse	MCA	
57	Zusammenfassung	AB	[DE] Ein Verfahren zum Optimieren einer Fertigung umfasst ein Empfangen von Signalen, die Informationen über eine Qualität der Fertigung umfassen, und ein Ermitteln einer Übereinstimmung in Abhängigkeit der empfangenen Signale und mindestens einem vorgegebenen Schwellenwert. Des Weiteren umfasst das Verfahren ein Ausführen einer jeweils vorgegebenen Aktion zum Optimieren der Fertigung, wenn keine Übereinstimmung in Abhängigkeit der empfangenen Signale und dem mindestens einen vorgegebenen Schwellenwert ermittelt wurde.
56	Entgegengehaltene Patentedokumente/Zitate, in Recherche ermittelt	CT	 US020030220709A1  US020130190913A1
56	Entgegengehaltene Patentedokumente/Zitate, vom Anmelder genannt	CT	

INID	Kriterium	Feld	Inhalt
56	Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur/Zitate, in Recherche ermittelt	CTNP	
56	Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur/Zitate, vom Anmelder genannt	CTNP	
	Zitierende Dokumente		Dokumente ermitteln
	Sequenzprotokoll		
	Prüfstoff-IPC	ICP	↗ G06Q 10/04 ↗ G06Q 50/04 ↗ G07C 3/08 ↗ G07C 3/14

Sie befinden sich hier > [DEPATISnet-Startseite](#) > [Trefferliste](#) > Bibliografische Daten

[Impressum](#) | [↗ Datenschutz](#) | [↗ Erklärung zur Barrierefreiheit](#)

© 2025 Deutsches Patent- und Markenamt | Version 6.8.0-0619 vom 8. Juli 2025